This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 64-063297

(43) Date of publication of application: 09.03.1989

(51) Int.CI. H05B 33/22

(21) Application number: 62-219433

(71) Applicant: NEC CORP

(22) Date of filing: 01.09.1987

(72) Inventor: SANO YOSHIO

UCHIUMI KAZUAKI

(54) EL ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To increase the light absorption factor of an entire luminescent display surface and thereby make an internal electrode hard to be seen by using a high dielectric ceramic sintered body having a large light absorption factor as a part or whole of a ceramic insulation layer.

CONSTITUTION: An internal electrode 2 is deposited and formed to have a thickness of about 3 μ m on a ceramic substrate 1, using an alloy of silver and palladium, and a high dielectric ceramic insulation layer 3 of a large light absorption factor is formed thereupon. Tie complex perovskite compound of a PbTiO₃ system is used as a parent material for a ceramic insulation layer of a large light absorption factor. As a contaminant, a ceramic blended with 2mol% of Mn oxide is used. A ceramic base 1, the internal electrode 2 and said insulation layer 3 are monolithically sintered, thereby forming a ceramic substrate 4. And a luminescent layer 5 is formed on the insulation layer 3, using a vacuum deposition method. The luminescent layer 5 comprises ZnS containing about 1mol% of Mn, and the thickness thereof is taken at $0.4\,\mu$ m. Furthermore, a transparent electrode 6 with an ITO membrane of $0.2\,\mu$ m thickness is formed on said luminescent layer 5 by a sputtering method.

Concise Explanation

JP A 64-63297 discloses that an EL device is disclosed comprising a ceramic substrate, an internal electrode applied to the substrate, a ceramic insulating layer formed on the internal electrode from a high permittivity sintered ceramic material having added thereto a substance for increasing light absorbance, and a light emitting layer and a transparent electrode formed on the insulating layer.

⑮ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭64-63297

Mint_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月9日

H 05 B 33/22

8112-3K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

EL案子 の発明の名称

> 頤 昭62-219433 创特

昭62(1987)9月1日 95 田田

@発 明 者 佐 野

與 志 雄 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

和明 伊発 明 者 日本電気株式会社 の出 願 人

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 内 原 砂代 理 人

1 発明の名称 EL素子

2. 特許請求の範囲

- (1) セラミック基部に被労した内部電極と、前記 内部電極上に光吸収率を増大させる物質を添加 して形成した高勝軍のセラミッタ協給体からな るセラミック絶象層と、前記絶象層の上に救産 される発光層かよび透明電極とを含むことを停 故とするBL米子。
- ② セラミック基部に被対した内部電極と、前記 内部電極上に火光吸収率を増大させる物質を認 加して形成した高額電率のセラミック協納体か らなる第一のセラミック絶縁階と、前記第一个 絶集庫と 前記第一の絶録層の上に形成した通 常の高詩電率セラミック焼結体からなる第二の セラミック絶象階と、前記第二の絶象器の上に 積層される発光層シよび透明電框とを含むこと

を特徴とするEL米子。

- (3) セラミック絶縁層として、PZT.BaTiOa, PbTIO。の少なくとも一つを含む複合ペロブ スカイト化合物を用い且つ光吸収率を増大させ る物質として、 Cr.Mn, Fe.Co.Ni, Cu, Pr Nd のうちの少なくとも一つ以上の酸化物を用 いた特許簡求の範囲第1項記載のEL業子。
- (4) 第一かよび第二のセラミック絶録層として、 PZT,BaTiOa.PbTiOaの少なくとも一つを 含む複合ペロプスカイト化合物を用い且つ前配 第一のセラミック絶縁層に抵加する先張収率を 増大させる物質として、 Cr, Ma, Fe, Co, Ni, Cu, Pr, Nd のうちの少なくとも一つ以上の政 化物を用いた特許請求の範囲第2項記載のEL 堂子。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は発光表示装置や近年進歴の著しい情報 **機器増末として用いられる自己発光型ディスプレ**

特開昭64-63297(2)

イヤ面光線として利用される交流駆動型BL集子 に関し、特に高跨電率セラミック焼給体を絶録層 に用いたBL集子に関する。

【従来の技術】

従来のかかるEL業子は、例えば低電圧駆動が 可能で絶象破壊に対して非常に安定な新構造のE L集子として、セラミック絶象移腹EL業子が 1985年度のインターナショナル・ディスプレイ・ リサーチ・コンファレンス子積集・173頁に報 告されている。

第3回はかかる従来の一例を説明するためのセ タミック絶象薄膜を13米子の断面図である。

第3図に示すように、BI案子の一部を構成するセラミック基板1(はセラミック基部11)と、
とのセラミック基部11の上にプラナナ中級・ペ
ラジウム合金等を被増した内部電板12と、との
内部電板12の上に費用されたPZT系。BaTiO。
系またはPbTiO。系統のペロプスカイト化合物
等からなる高調電率のセラミック絶線層17とか
ら辨成されている。また、との高砂電率のセラミ

発光層15の伝導帯に電子が励起される。この電子は電界によって加速され、十分なエネルギーを持って発光中心に衝突する。この衝突時のエネルギーにより液晶な励起状態に上がった発光中心の電子が勘底状態へ及る駅に、発光中心に固有なエネルギー値を持った光が放出される。突然には結晶格子との相互作用等により発光スペクトルはある程度の拡がりを持つ。かかる発光中心としてMo.
TbF3.8mF3 またはPsF3を用いた場合は、それぞれ黄星色、緑色、赤色、白色の発光が観測される。

とのようなセラミック絶級な際EL素子の発光 原理は従来のガラス基板上に移動の絶異原子発光 層を積弱した交流駆動型の容原EL素子(エス・ アイ・ディ・74・ダイジェスト・オブ・テクニ カル・ペーペーズ 84頁)と変わるものではな い。しかし、数10m型度の厚さの非常に時間率 の高いセラミック絶異層7の効果により、動作係 Eの大幅な低減かよび絶縁破壊電圧に対する非常 に高い安定性が実現されたものであり、低コスト ック総級 № 17の上には Ma. TbFa. SmPa. PsFa 等の発光中心を含む ZaS からなる 薄質の発光層 15が真空蒸滞法 ヤスペック 蒸潜法により 蒸滑され、ついでとの発光層 15の上に ITO 等からな る透明電極 16 が成 図される。かかる 構造の EL 米子を 駆動するには、内部電極 12と透明電極 16 とに交流電源 18 が接続される。

尚、ととに示す例は、所額片絶縁型のものであるが、発光層15と透明電極18との間にYsO5 ヤTasOs 等の存款絶景層を挿入して二重絶機構 造としてもよい。

次化、従来のかかるセラミック総裁容譲EL業 子の発光原理化ついて以明する。

すなわち、第3図にかいて、発光層15は発光 開始前は単純なコンデンサと考えられる。使って、 内部電極12と透明電板16との間に交流電弧18 から交流電圧を印加すると、発光層15及びセラ ミッタ絶録値17にはそれぞれの静電容量に応じ た電圧が加えられる。この発光層15に加えられ る電界が十分大きくなると(約10°V/cm以上)。

の面光数や発光表示装置として期待されている。 【発明が解決しよりとする関盤点】

上述したようなセラミック絶録常謀ELま子は 低低圧助作が可能であり、船級破壊に対しても高い 安定性を有している。しかしながら、かかるE L業子にかいて、セラミック絶録層に用いる高齢 電率のセラミック絶結体は一般に白色に近いもの か多く、またEL素子の絶録層として十分を訪ぜ 容量を確保するために厚さを移くすると透明度が 増してくる。とのため、内部電極の形状が見えて くるようになり、ディスプレイとして用いた場合 の品位が扱われてしまりという欠点がある。

本発明の目的は、投示にあたって上述したよう な内部電極の形状などが見えたりするとともなく、 且つコントラストをも向上させた E L 素子を提供 することにある。

[間辺点を解決するための手段]

本発明のEL以子の部一の発明は、セクミック 遊部に技術した内部電響と、前紀内部は毎上に。 光吸収率を増大させる物質を添加して形成した高

特開昭64-63297(3)

静電車のセラミック統治体からなるセラミック総 録用と、前記絶録層の上に被形される発光層⇒よび透明電板とを含んで構成される。

さた、本発明のBL集子の第二の発明は、セラミッタ描記に被雇した内部電板と、前記内部電板 上にが光板収率を増大させる物質を耐加して形成 した高齢電率のセラミック協結体からなる第一の セラミック絶経暦と、前記第一の絶録層の上に形成 した通常の高砂電率セラミック協結体からなる 第二のセラミック絶録層と、前記第二の絶録層の 上に積層される発光限かよび透明電極とを含んで 構成される。

[作用]

本発明のEL票子の取一は、セラミック総称版の一部または会部に光吸収率の大きた高時電率セラミック協納体を用いることにより、同一の厚さの白色に近い従来のセラミック総級関よりも多くの光を吸収できるようにするものであり、これにより内部電視に入れても大量を減少し且つ内部電気により反射される光きより多く吸収されるので、

且つセラミック絶縁質の先吸収率を増大させると とができるので、内部電板の形状が見えたりする とともなく波示にあたってのコントラストを向上 させたりすることができる。

(美拉何)

次化、本系明の実施例についてB面を参照して 説明する。

第1図は本発明の第一の実施例を収明するため のセラミック能録解原EL票子の新面図である。

第1 内に示すように、セラミック基部1はセラミック材料とい一般的なアルミナとホウケイ取ガラスの混合物を用い厚さを約1 mに形成する。とのセラミック基部1の上に形成する内部電極2は銀成する。との内部電極2の上に形成する高間電影の光吸取率の大きなセラミック絶異沿るは厚としては高間電子のセラミックの母析としては高間電子でシック用として一般的に用いられるP2T系、外由TiO。系などの複合

内部電板を見えにくくすることができる。

せた、一方かかるセラミック絶録薄膜BLま子にかいては、発光層の発光特性が下地となるセラミック絶録層の材料や設面状態により変化を受けることがある。この原因は明確ではないが、セラミック絶験層から発光層へ向けてセラミックを設面の対したり、るにはないないなどができまった。このため、セラミック絶り層として光吸収率を増加させるながにある。このため、セラミック絶り層として光吸収率を増加させるがあると、発光層の健化物を認加した光吸収率の大きな発達であると、発光層の健化物を認加した光吸収率の大きな発達であると、発光層の健化物を認加した光吸収率の大きな発達であると、発光層の健化物を認加した光吸収率の大きな発達を対象によりに、一般には輝度がは少する傾向を示す。

そこで、本発明のEL法子の紙二は、セラミック総数層が内部は延と扱する側の面に光波収率の大き立高跨電率セラミック層を配置し、主た発光層が形成される側の面には通常の高級電源のセラミック層を用いて構成することにより、知度を始決のセラミック過程制度LL法子と同程度に保ち

ペロプスカイト化合物であればどれを用いてもよい。とのセラミック絶縁層3に退入する光吸収率を高めるための物質としては、悪移金属(Cr. Mn. Fe, Co. Ni, Cu, Nb, Mo. W など)やランタニン(Pr. Nd など)の彼化物を混入することができる。しかし、どの兄素を用いた場合でも、混入液が多すぎると光吸収率があまり増大しないわりに動電率の低下が著しくなってしまい効果的ではない。実際には0.1~5 モルメ程度、狙きしくは0.6~2 モルバーセントが適当である。

次化、かかる強入技を2モルパーセントとし、母材にPbTiO。 系の複合ペロプスカイト化合物を用いた場合につき、内部電極2がどの相反見えるかを目視により評価した結果を残1に示す。なン数1の進入物は全て酸化物として超入するものである。

没1からわかるように、が加速入物なしやTi の酸化物を設加した場合は、内部気体が見えてし まうが、Cr.Ma.Fe.Co.Ni.Cu.Pr または Nd などの似化物を添加した場合は、内部気候を

待開昭64-63297(4)

混入物	内部電極の 見えにくさ	混入物	内部電極の 見えにくさ
C,	0	Ctt	0
Mn	O	P,	0
Fo	0	Nd	0
C _o	0	Ti	×
Ni	0	が加なし	×

表 1 (〇: 見えづい 〇: 足えにくい ×: よく見える

見えにくくするととができ、特にMn ヤFe の酸化物が内部電極を見えにくくする混入物として適当である。との効果は、母材をPZT系やBaTi O。系の複合ペロプスカイト化合物にかえた場合でも同様の傾向にある。

本実施例では、光吸収率の大きなセラミッタ絶 無層3として母材にPbTiOa系の複合ペロプスカイト化合物を用い、洗入物としてMa の酸化物を 2モルパーセント洗入したセラミックを用いている。

次に、上述したセクミック基部1, 内部電板2,

はック絶録 周3 を厚さ2 0 mm 程度形成する。次 に、このセクミック絶録 周3 の上に従来と同じる 常のセクミック絶録 周7 を厚さ2 0 mm 程度に検 層して形成する。実際には、かかるセクミック 絶録 1. 内部電弧2. 光級収率の大きなセクショック 絶録 間3, セクミック絶録 周7 が一体に焼結3, セクミック絶録 個でいる。 でセクミック が成している。 になったとにより、セクミック絶録 周3 で の表面状態により発光性が変化する発光 周3 で の表面状態により発光性が変化する発光 元 回 や性を従来の B L 素子と同様のままで発光 えい くくすることができる。 また、かかる構造により で、かかる構造により によっている。 とくているとができる。 といいている。 にはいいている。 といいている。 にはいいる。 にはいいている。 にはいいる。 といいでは、 といいでした。 といいでもる。 といいでした。 といいでもる。 といいでもる。 といいでした。 といいでは、 といいでした。 といいでした。 といいでは、 といいでした。 といいでしいでした。 といいでした。 といいでした

尚、との第二の実施例にかいて述べたセクミック 起腺薄膜 B L 未子の寸弦や製法は前述したセクミック 超級 M の一部または全部を光吸収率の大きなセクミック 層に変えた場合の効果を努らかにするために述べたものであり、本発明の適用範囲を何ら割限するものではない。

光吸収率の大きなセクミック絶縁層3を一体に施 結してセクミック基板4を形成する。ついで、と のセクミック基板4の表面を形成する光吸収率の 大きなセクミック絶縁層3の上に真型蒸滞法によ り発光層5を成蹊する。との発光層5はMnを約 1モルパーセント合む2n3からなり、厚さはQ4 Amとする。更に、との発光層5の上にスペック 法により1T0をQ2Amの厚さに成蹊した透明 電板6を形成する。

とのようにして形成したBLボ子と従来のセラミック絶象層を有するBLボ子とを比較した結果、 発光輝度は半分近くに低下するものの内部電極の パターンがほとんど見えなくなり且つコントラストが10%ほど向上している。これは明らかに先 吸収率の大きなセラミック絶象層を採用したことによるものである。

第2回は本発明の第二の実施例を説明するため のセラミック絶縁が謀正上常子の断回図である。 第2回に示すように、セラミック書部1上に形成された内部電話2の上に先数収率の大きなセラ

また、本発明では尊談部分として発光層 5 及び 内部電極 6 を有するセラミック絶操得展 E L 素子 を例にとって説明したが、本発明は発光層 5 と光 数収率の大きなセラミック絶繰層 3 の間、または 発光層 5 とセラミック絶緩層 7 の間にセラミック から発光層への金属イオン拡致を防ぐための禅膜 絶縁層を更に形成してもよい。また、発光層 5 と 透明電極 8 の間に準度絶縁層を有するいわゆる二 重絶最短の B L 素子にかいても効果があることは いうまでもない。

更に、上述した二つの実施例と異なり、セラミック基部1を省略して先数収率の大きなセラミック総兼備3, あるいは光吸収率の大きなセラミック総兼備7の部分を厚くしてBL米子の機械的強度を保持したりすること。
かよびこれらをさらに補強用の板に貼りつけて形成することなどの変形も本発明の技術的範囲に含まれる

また、上述の実施例では高脚電率セラミッタ絶 機層の元氏収率を増入させるために成入する限化

特開昭64-63297(5)

物を一種類のみの場合についても述べたが、必ず しも一種類に限定する必要はなく複数の酸化物を 用いてもよい。

(発明の効果)

以上説明した減り、本発明のBI素子は光吸収率の大きな高額電率セラミックス焼納体をセラミック 施線層の一部されは全部として用いるととにより、発光表示面全体の光吸収率を増大させ、これによって内部電極を見えにくくすることが出来る。従って、本勢明はBI次子をディスプレイに用いる場合の表示品位を向上させるとともに、発光表示面全体の光吸収率を増大させることによりコントラストの向上をはかることができるという効果がある。

4. 図面の信単な説明

第1四は本発明の第一の契約例を説明するため のセラミック絶無導施EL素子の断面図、第2図 は本発明の第二の実施例を説明するためのセラミ ック絶無導旗EL素子の断面図、第3回は従来の 一例を設明するためのセラミック絶録準度EL業子の斯函図である。

1 --・・セラミック高部、2 --・・・内部電板、3 --・・・ 大吸収率の大きなセラミック総数局、4 --・・・セラミック結板、5 --・・・ 透明電板、7 --・・・ 通路セラミック結構局。

代理人 弁理士 内 原 習

